科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成24年4月28日現在

機関番号:34419	
研究種目:基盤研究()	3)
研究期間:2009 ~ 2	2011
課題番号:21560	4 5 5
研究課題名(和文)	高温・高速・高感度動作を実現する単一光子検出器に関する研究
研究課題名(英文) 	Elemental technologies to develop single photon detectors having nigh temperature, high speed and high sensitivity operation
研究代表者	
楠 正暢 (KUSUNON	(I MASANOBU)
近畿大学・生物理工	学部・教授
研究者番号:202822	38

研究成果の概要(和文):

量子暗号通信のキーデバイスである単一光子検出器として、高温超伝導体でナノワイヤーを実現するための要素技術についての研究を行った。高温超伝導材料にはYBa₂Cu₃0_y (YBC0)を用いて実験を行い、Pt/Auのキャップ層を持つYBC0膜で、250回折り返された、全長約25mm、幅200nmのメアンダ型ナノワイヤーを100×100µm四方の領域に形成できることを示した。また、YBC0エッチング時に試料ステージを液体窒素冷却することにより、プラズマ衝撃による劣化の影響を抑制し、幅200nm、長さ1µmのワイヤーで超伝導電流を確認した。さらに、YBC0と単結晶基板のヘテロ界面近傍における格子不整合について検討し、20nmの膜厚でも80K以上の臨界温度(T_c)を持つYBC0膜の作製に成功した。一方、80~10nmの範囲で膜厚とT_cの関係を調べ、実効的に膜厚10nm以下の特性を有する高温超伝導ナノワイヤー実現の可能性を示し、その方法について述べた。

研究成果の概要(英文):

We studied elemental technologies to develop HTS (high temperature superconducting) nano-wire as a key device "single photon detector" for the quantum cryptographic communication. Experiments were carried out using YBa₂Cu₃O_y (YBCO). It was shown that a 200-nm-wide and 25-mm-long nano-wire could be constructed in a 100 μ m × 100 μ m square by using a 250-turns-meandering configuration. We examined how to suppress superconductivity degradation in the nano-wire during plasma etching processes. Liquid N₂ cooling to a sample stage was effective to prevent the degradation from ion bombardments of plasma etching. As a result, superconducting current was observed for a 200-nm-wide and 1- μ m-long nano-wire. We also investigated lattice mismatching at a hetero-epitaxial surface between YBCO and single crystal substrate. Then, YBCO thin film with only 20 nm thickness showed critical temperature (T_c) over 80 K. On the other hand, a T_c dependence on the YBCO thickness was examined from 80 nm to 10 nm. It produced a possibility to realize very thin HTS nano-wire with effective thickness less than 10 nm.

(金額単位:円)

			(亚碩平臣・11)
	直接経費	間接経費	合 計
2009 年度	1, 800, 000	540, 000	2, 340, 000
2010 年度	1, 000, 000	300, 000	1, 300, 000
2011 年度	600, 000	180, 000	780, 000
年度			
年度			
総計	3, 400, 000	1, 020, 000	4, 420, 000

研究分野: 工学 科研費の分科・細目: 計測工学 キーワード: センシングデバイス、単一光子検出

1. 研究開始当初の背景

単一光子を情報の担体として用いること で、原理上絶対的安全性を持ち、高速ネット ワークを実現できる量子情報通信が注目さ れている。平成19年には、世界最速(10GHz)、 最長(200km)の量子暗号鍵配送試験の成功 が報じられ¹⁾、実用化への期待が一層高まっ た。この試験では、光子数を識別するための 単一光子検出器として、超伝導ナノワイヤー が用いられた。超伝導ナノワイヤーは、ナノ スケールの線断面をもつメアンダ構造のワ イヤーであり、常伝導転移する臨界点直下の 電流をバイアスした状態で使用され、光子の 入射エネルギーにより瞬間的に生じる局所 的常伝導転移を数 10psの高速信号として得 ることで、単一光子検出器として動作する。

本研究の全体構想としては、現在までに最高性能が得られているNbN(臨界温度T。=約15K)のナノワイヤーを、T。が約90Kの高温超伝導体(HTS)で構成することを目標とするもので、技術的に大きな飛躍が必要となる。これを実現することができれば電子-フォノン緩和時間、フォノン拡散時間の短縮、また、動作速度、動作温度の向上が期待できる。また、HTSは金属光沢がない材料であるため、光子の反射を抑え検出感度(量子効率)を改善できる点でも有利である。

2. 研究の目的

本研究の最終目標は、単一光子検出用超伝 導ナノワイヤーの高性能化にあるが、本事業 の実施期間においては、それを実現するため の作製プロセスの検討を主眼に置いている。 具体的には、光子1個の入射による僅かなエ ネルギーに対し、常伝導転移パルスを生成す るのに十分な極めて小さい線断面を作製す るたがを確立しなければならない。したがっ て、リソグラフィーとエッチングで決定され る線幅に対する加工技術のほかに、HTSを高 い品質を維持したまま極めて薄く成膜する 技術が必要である。現行のNbNナノワイヤー を例にとると、情報通信研究機構では薄さ 4nm以下の高品質薄膜を用いて高性能光子検 出器を実現しているため、²⁾これに迫る膜厚

- 1) H. Takasue et al., "Quantum key distribution over a 40-dB channel loss using superconducting single-photon detectors", NATURE PHOTONICS, Vol.1, p.343-348 (2007).
- Vol.1, p.343-348 (2007).
 2) S. Miki et al., "NbN Superconducting Single-Photon Detectors Prepared on Single-Crystal MgO Substrates", IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol.17, pp.285-288, (2007).

が要求される。これまで、ナノワイヤー開発 にHTSの適用が行われなかった背景には、HTS のヘテロエピタキシー膜の極薄化が困難で あったことが大きな理由として存在してい る。

本研究では、これらの問題を改善する、HTS のナノ加工法と成膜方法を検討することが 目的である。

研究の方法

超伝導ナノワイヤー型の単一光子検出器 の場合、動作原理が、光子の入射エネルギー による超伝導電子対の破壊に基づいている ため、僅かなエネルギーで常伝導転移するよ う感度を得るためには、ワイヤー内の超伝導 電子対の数を下げる必要がある。超伝導電子 対数はナノワイヤーの臨界電流I。に比例する ので、観測容易な評価パラメータとしてはI。 を下げればよいことになる。さらに、

 $I_{c} = J_{c} \times w \times t \quad \cdots (1)$

(J.: HTS膜の臨界電流密度、w: ワイヤー幅、 t: ワイヤー厚さ(膜厚))であるため、設 計上は、J., w, tそれぞれについて値を下げ る方法を検討するとともに、確率的な受光面 積を確保する目的で、図1のイメージように HTSナノワイヤーを細密にする、メアンダ構 造の実現法についても検討を行う。

4. 研究成果

4.1) デバイス構造の作製法の検討

まずはじめに、メアンダ型HTSナノワイヤ ーを実現するためのデバイス構造と、電子線 リソグラフィーの条件について検討を行っ た。HTSには、YBa₂Cu₃0,(YBCO)を用いた。YBCO の膜表面には、加工プロセス中の超伝導性の 劣化防止と電極(ボンディングパッド)の役 割を兼ね、Au層を設けた。これは、光を基板 裏側から入力することを想定した際の、反射 層の役割も果たす。しかし、Au層上で電子線 描画を行うと、反射電子によるバックスキャ ッタにより露光精度が低下するため、それを 防ぐためのPt層を最表面に設けた。図1のよ うなメアンダ構造を幅 200nmのライン・アン



図1. 単一光子検出の原理

ド・スペースで実現するための描画条件を最 適化し、図2のような結果を得た。この試料 は、250回折り返された、全長約25mm、幅200nm のナノワイヤーが100×100µm四方の領域に 形成されたものである。ナノワイヤーを分割 して特性を読み取る目的で、ワイヤー端部折 り返し箇所に設けた電極との結合部分を拡 大した写真である。

4.2) エッチング時の劣化の軽減と超伝導 特性の確認~wの検討~

上記、4.1 のように、電子ビームリソグラ フィーと、プラズマエッチングにより素子形 状は実現できることが示されたが、化学的安 定性の乏しい YBCO のナノ加工時 (プラズマ エッチング時)には超伝導特性の劣化が顕著 に表れることが過去の研究で明らかとなっ ているため、劣化の少ないプロセスについて の検討を行った。従来は、イオン衝撃の少な い、電子サイクロトロン共鳴(ECR)プラズ マエッチングを用い、試料ステージを―30℃ のエチレングリコール液を循環させること により冷却することで、プラズマの衝撃、温 度上昇による超伝導特性劣化を抑制し、一定 の効果が得られていた。しかし、それでもな お、再現性が十分ではなかったため、試料ス テージを液体窒素冷却が行えるよう改良を 施した。その結果、再現性が向上し、図3の ように、線幅 200nm、長さ1µmのナノワイヤ ーで超伝導電流を観測できるに至った。

4.3) a軸配向膜を利用した低J。化の検討

次に、YBCO膜のJ。を下げる可能性について の検討を行った。超伝導デバイス作製に多く 用いられるc軸配向YBCO膜に対し、a軸配向膜 のJ。は同じ動作温度下では一桁程度小さい。 その異方性を利用できれば、大幅にI。を下げ ることが可能となる。そこで、a軸配向膜作 成条件の検討を行ったが、結晶としては良好 なa軸配向を示す膜であってもT。の高いもの を得ることはできなかった。高い臨界温度を 示す成膜条件を見出すためには、より長期間 の検討が必要と判断し、将来的な可能性は残 しつつ、本研究期間で行うことは困難と結論 付けた。

4.4) 極薄 HTS 膜作製法の検討~ t の検討~ I。を下げるためのもう一つの方法として、 膜厚wを薄くすることも重要であることから、 以下のように詳細な検討を行った。

成膜には、直流マグネトロンスパッタリン グを用い、c軸配向YBCOに対して実験を行っ た。ターゲットー基板間距離 30 mm、雰囲気 ガス流量Ar: 02 = 20: 20 (ml/min)、全ガ ス圧 45Pa、カソード電圧 190 V、カソード電 流 50 mAを一定とし、基板加熱ヒーター温度 をパラメータとして、750 ℃~875 ℃の範囲



図 2. HTS ナノワイヤー端部を拡大した 電子顕微鏡写真



で変化させ成膜を行った。このときの基板ヒ ーター温度に対する超伝導転移温度T。、およ びYBCOの結晶性について、格子定数の異なる 3 種類の単結晶基板 (MgO (100), SrTiO₃ (100), NdGaO₃ (110))について比較を行った。 また、MgO基板については空気中での潮解性 があるため、成膜直前に酸素プラズマによる 表面クリーニングを行ったものを用いた。

図 4(a) は、成膜時の基板温度を変化させ、 膜厚 80nm一定のYBCO (005) 面に対する θ - 2 θ法によるX線回折(XRD)強度を示したもの である。それぞれの基板に対し図中にプロッ トされている温度領域においては、YBCOがc 軸配向のみを示し、各プロットに対する最低 温度以下では、a軸配向が混在し始める。今 回、基板ヒーターの最高到達温度の制限から 875℃以上での成膜を行うことができなかっ たが、最も高いXRD強度を示す温度が、MgO, SrTiO₃, NdGaO₃の順に高温側へシフトする傾 向を読み取ることができる。また、YBCOとの 格子不整合率が小さく、それぞれ 2.11, 1.04% のSrTiO₃, NdGaO₃に対し、不整合が大きな 7.12%のMgOについてはピーク強度の最高値 が低いことが示され、ヘテロエピタキシャル 界面でYBCOが成長し始めの重要性が表れて いる。

次に、これらの試料に対して、直流四端子 法でYBCO薄膜の抵抗-温度特性を測定し、ゼ ロ抵抗を示すT。をプロットした結果を図 4(b)に示した。全体的傾向として、T。が高く とも85 K程度にとどまっており、YBCOのT。 として報告されている 90K 以上の値に達し ないのは、今回用いた成膜システム、または、 ヒーター温度以外の成膜パラメータなど別 の要因に支配されているものと考えられる。 傾向としては、結晶性が最高点を示す温度で なくとも、c軸配向を示す温度領域で高いT。 を示すことがわかる。これは、格子不整合が 緩和された膜表面近傍の良好な超伝導層の みの性質を反映しているためと考えられる。 具体的には、基板との界面近傍に、結晶性が 低くT。が低い領域が存在していても、膜の全 体的な結晶方位としてc軸配向さえ満たされ ていれば、格子不整合が緩和される膜厚以上 の膜表面近傍では、良好な超伝導性を示す膜 質を有する状態が存在し得る。このような状 況下では、四端子測定で読み取られるT。は膜 表面の性質しか反映していないと解釈する ことができる。そこで、膜の厚さ方向の性質 が現れる評価方法として、残留抵抗比(RRR) に関して考察を行った。SrTi0₃上に 875 ℃で 成膜した試料を例に図 5(a)を用いて説明す る。常伝導領域における抵抗曲線を0Kまで 外挿した時の抵抗値を残留抵抗R(0)と定義 し、300 Kでの抵抗値R(300)との比で表した 値をRRR=R(300)/R(0)とした。図4(a),(b) との対応を見やすくする目的で、RRRの逆数 を図5 (b)にようにプロットした。このパラ メータは、格子散乱を受ける常伝導電子が受 ける抵抗に関するものであるため、膜中の格 子の不規則性の尺度となる。したがって、図 5(b)では膜表面の性質のみしか得られない のに対し、図5(b)では膜の厚さ方向の情報 を得ることができる。この結果は、図5(a) のXRDによる結晶性の傾向とよく一致してお り、Mg0では 800-825℃付近、SrTi0₃では 850-875℃付近、NGOでは 875℃以上の値で膜中の 格子の不規則性が低くなることを意味して いる。すなわち、YBCO堆積開始近傍の格子歪 の領域が最も小さいことを示している。

そこで、今回の実験の中で最も良い結晶性 を示したSrTiO₃基板を用いたヒーター温度 875℃の場合に、膜厚を80 nmから40,20,15, 10 nmとしてそのT。についての評価を行った。 その結果を図6に示す。膜厚の減少とともに T。が減少するが、15 nm以下で、急激に低下し ており、YBC0堆積開始直後の膜厚 20 nm未満 の領域ではで結晶中に歪や欠陥が多いこと を示している。比較のため、同図にMg0基板 上に厚さ 80 nm, 20 nmのYBCOを堆積した場合 もプロットした。膜厚 20 nmにおいて、MgO 基板上のYBCOのT。は液体窒素温度 77K以下 (73.6K)であるのに対し、SrTiO₃基板ではT。 =80.8Kで超伝導転移することが分かった。よ り高温で成膜できるヒーターを用いること ができれば、格子不整合の小さいNdGa0,基板



を適用することで、さらに薄くすることが可 能であると予想される。また、ヒーター温度 以外の成膜パラメータの最適化により、少な くとも臨界温度の向上は期待することがで きる。

さて、本実験で、膜厚に対するT。の関係が 明らかとなったため、図7のような単純化し たモデルをもとに、以下のような活用方法に ついて考察した。たとえば、80.9 K付近の動 作温度を仮定する場合、膜厚15 nm以下の領 域は超伝導転移していないため、光エネルギ ーで表面の厚さ5 nmの領域にのみ存在する超 伝導電子対を破壊すれば常伝導転移が得ら れるため、実質的には5 nmの厚さを持つ超伝 導膜で光/超伝導変換ナノデバイスを作製で きることになる。これとは逆に、動作温度を 24.1 K付近に設定するならば、膜厚10 nmの YBCOでデバイス作製を行うことにより、実用 上、光/超伝導変換デバイスが動作する条件 を満たせる可能性があるといえる。

4.5) まとめ

単一光子検出器の高性能化を目的として、 高温超伝導ナノワイヤー作製法の研究を行った。要素技術として必要な、デバイス構造 を電子線リソグラフィーで得る方法、YBCOの ナノ加工時における超伝導特性の劣化を抑 制し再現よくプラズマエッチングする方法、 YBCOの膜厚を薄くする方法について検討を 行い、以下のような結果を得た。

Pt/Au のキャップ層をもつ YBCO 膜で、250 回折り返された、全長約 25mm、幅 200nm のナ ノワイヤーを 200nm 幅のライン・アンド・ス ペースで 100×100 μ m 四方の領域に形成可能 であることを示した。

ECR プラズマエッチングの試料ステージを 液体窒素冷却することで、線幅 200nm、長さ 1µmのナノワイヤーで超伝導電流を観測で きた。

a軸配向YBCO膜を用いれば、一桁程度低い J。を期待できるが、良好な結晶性を示すa軸配 向であってもT。の高いものを得ることは困難 であり、高い臨界温度を示す成膜条件を見出 すためには、より長期間の検討が必要と判断 した。

YBC0と単結晶基板のヘテロ界面近傍にお ける格子不整合について検討し、20nmの膜 厚でも80K以上のT。を持つYBC0膜の作製に成 功した。また、T。と膜厚の関係を、80~10nm の範囲で調べ、簡単なモデル化を行うことに より、ナノワイヤーの動作温度に合わせた間 圧を設計に盛り込むことにより、実効的に 10nm以下の膜厚の特性を実現するHTSナノワ イヤーの作製の可能性を示唆する結論を導 くことができた。



図7. YBCO/基板界面付近における膜質のモデル

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計5件)

- 伊藤大介、小谷克己、三宅智貴、西川博昭、本津茂樹、<u>楠正暢</u>;光/超伝導変換デバイスの感度向上を目的とした極薄高温超伝導膜の作製法の研究,電気学会論文誌C,査読有,印刷中.
- ② <u>D. Okai</u>, R. Nagai, G. Motoyama, H.M. Kimura and A. Inoue; Superconducting property of Zr-Co-Al-Nb metallic glass, Physica C, 査読有, Vol. 471, 2011, pp. 725-729.
- ③ <u>S. Miki</u>, T. Yamashita, M. Fujiwara, M. Sasaki, Z. Wang; Characterization of Coupling Efficiency and Absorption Coefficient for Fiber-Coupled SNSPD With an Optical Cavity, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 査読有, Vol. 21, 2011, pp. 332-335.
- ④ <u>D. Okai</u>, R. Nagai, G. Motoyama, T. Fukami, T. Yamasaki, Y. Yokoyama, H. M. Kimura A. Inoue; Superconducting property of Zr-Co and Zr-Co-Al alloys fabricated by rapid solidification, Physica C, 査読有, Vol. 40, 2010, pp. 1048-1051.
- ⑤ <u>S. Miki</u>, M. Takeda, M. Fujiwara, M. Sasaki, A. Otomo, Z. Wang; Superconducting NbTiN Nanowire Single Photon Detectors with Low Kinetic Inductance, Applied Physics Express, 査読有, Vol. 2, 2009, pp.075002(3 page).

〔学会発表〕(計 10 件)

- 伊藤大介,三宅智貴,小谷克己,高橋晋 也,西川博昭,<u>楠正暢</u>,本津茂樹;光/ 超伝導変換デバイスの感度向上を目的と した極薄酸化物超伝導膜の作製,電気関 係学会関西連合大会,2011年10月30日, 兵庫県立大学.
- ② <u>D. Okai</u>, G. Motoyama, H. M. Kimura, A. Inoue; Superconducting property of

Zr-Cu-Al-Ni-Nb alloys, 24th Symposium on Superconductivity, Oct. 26. 2011, Tokyo, Japan.

- ③ <u>S. Miki</u>, T. Yamashita, M. Fujiwara, M. Sasaki, Z. Wang; Performances of superconducting nanowire single photon detectors at 800 nm wavelength, Superconductivity Centennial Conference, Sep. 20, 2011, Netherlands.
- ④ 高橋晋也,伊藤大介,<u>楠正暢</u>,西川博昭,本津茂樹;酸化物超伝導薄膜のダメージレスナノプロセスに用いるエピタキシャル成長阻害層の検討,電気関係学会関西連合大会関西連合大会、2010年11月14日,立命館大学.
- ⑤ 高橋晋也,馬場康仁,<u>楠正暢</u>,西川博昭,本津茂樹;酸化物超伝導薄膜のダメージレスナノ加工プロセスの検討,電気関係学会関西連合大会関西連合大会,2010年11月13日,立命館大学.(奨励賞受賞によるポスターシンポジウム講演)
- (6) <u>S. Miki</u>, T. Yamashita, M. Fujiwara, M. Sasaki, and Z. Wang; Multichannel SNSPD system with 21% system detection efficiency at 1550nm wavelength, Applied Superconducting Conference, Aug. 1-6, 2010, Washington D.C.
- ⑦ 馬場康仁,高橋晋也,<u>楠正暢</u>,西川博昭, 本津茂樹;酸化物超伝導薄膜のダメージ レスナノ加工プロセスの検討,電気関係 学会関西支部連合大会 2009 年 11 月 7 日,大阪大学.
- (8) <u>D. Okai</u>, R. Nagai, T. Fukami, T. Yamasaki, Y. Yokoyama, A. Inoue; Superconducting property of Zr-Co and Zr-Co-Al alloys fabricated by rapid solidification, 22nd International Symposium on Superconductivity, Nov. 2-4, 2009, Tsukuba, Japan.
- (9) <u>S. Miki</u>, M. Takeda, M. Fujiwara, M. Sasaki, Z. Wang; Compact packaging of optical cavity structured SNSPDs with high optical coupling efficiency, 9th European Conference on Applied Superconductivity, Sep. 13-17, 2009, Dresden, Germany.
- ① <u>三木茂人</u>,武田正典,藤原幹生,佐々木 雅英,王鎮;光キャビティ付超伝導ナ ノワイヤ単一光子検出器の開発I,第70 回応用物理学会学術講演会,2009年9月 8-11日,富山大学.

[その他]

奨励賞受賞 馬場康仁,高橋晋也,<u>楠正暢</u>,西川博昭, 本津茂樹;酸化物超伝導薄膜のダメージ レスナノ加工プロセスの検討,電気関係 学会関西支部連合大会 2009 年 11 月 7 日,大阪大学.

6. 研究組織

(1)研究代表者
 楠 正暢 (KUSUNOKI MASANOBU)
 近畿大学・生物理工学部・教授
 研究者番号: 20282238

(2)研究分担者

三木 茂人 (MIKI SHIGEHITO)
 情報通信研究機構・主任研究員
 研究者番号:30398424
 岡井 大祐 (OKAI DAISUKE)
 兵庫県立大学大学院・工学研究科・助教
 研究者番号:60336831

(3)連携研究者

なし